

近年、各種材料の微細化や多機能構造を有する材料がめまぐるしく発展し、この各種材料の評価がクローズアップされてきております。この各種材料の表面や断面の評価手法として、おおきな威力を発揮するのが走査電子顕微鏡です。従来CCD デジタルスコープで観察を行っていた数千倍程度の観察を、焦点深度が深く、前処理なしで行える卓上低真空走査電子顕微鏡で行うことが着目され、大きな成果を挙げております。

当施設では**TM3030**を既設しておりますが、この度**EDS**を増設いたしました。つきましては、メーカーから講師をお招きし、**SEM・EDSの原理から応用事例まで**をご紹介します**SEM・EDSセミナー**を開催させていただきます。

皆様のご参加をお待ちしております。

参加無料

日 時 **2019年5月29日（水） 13:00～15:30**

プログラム

1.走査電子顕微鏡（SEM）の基礎と応用 13:00～14:00

（株）日立ハイテクノロジーズ 評価解析システム営業本部 上村 健 氏

2.エネルギー分散型X線分析装置（EDS）の基礎と応用 14:15～15:30

オックスフォード・インストゥルメンツ（株） 分析機器事業部 田原 知浩 氏

場 所 **富山大学 総合教育研究棟（工学系）36講義室（G16）**

定 員 **100名**（お申込み受付は先着順とし、定員になり次第、締切ります。）

申込方法 **メール記入例を参考にE-mailで機器分析施設までお申し込みください。**

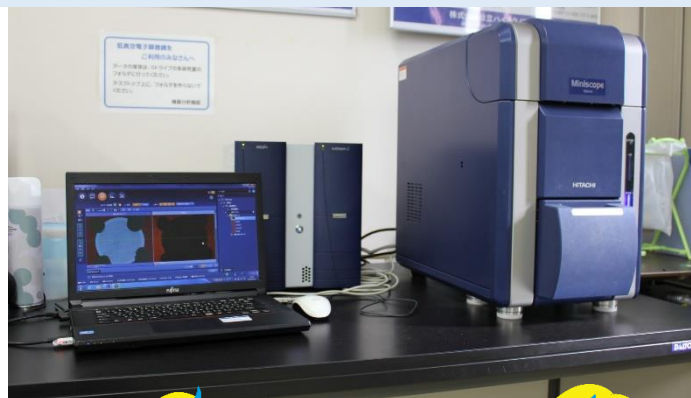
申込締切 **5月22日（水）**

【メール記入例】

【件名】 SEM・EDSセミナー参加希望

【本文】（学内の方）
 氏名・学年・学部・指導教員名
 連絡先E-mail

（学外の方）
 氏名・所属・職業・連絡先E-mail



申込・問合せ先

富山大学 研究推進機構 研究推進総合支援センター
 自然科学研究支援ユニット 機器分析施設
 内線（6715） Tel：（076）445-6715
 E-mail：cia00@ctg.u-toyama.ac.jp



マスコットキャラクター
 ぶんせきっず